(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3100339号 (P3100339)

(45)発行日 平成12年10月16日(2000.10.16)

(24)登録日 平成12年8月18日(2000.8.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		
G 0 2 F	1/13	500	G 0 2 F	1/13	500
G 0 2 B	5/30		G 0 2 B	5/30	
G 0 2 F	1/1335		G 0 2 F	1/1335	

請求項の数4(全 6 頁)

(21)出願番号	特願平8 -177771	(73)特許権者	596098438	
			ロリク アーゲー	
(22)出顧日	平成8年7月8日(1996.7.8)		ROLIC AG	
			スイス国 ツェーハー6301 ツーク イ	
(65)公開番号	特開平9-33914		ネレ ギュターシュトラーセ 2	
(43)公開日	平成9年2月7日(1997.2.7)	(72)発明者	フーベルト ザイベルレ	
日太龍査審	平成8年7月8日(1996.7.8)		ドイツ連邦共和国 デー79576 ヴァイ	
(31)優先権主張番号	02036/95-7		ル アム ライン ポーデンゼーシュト	
(32)優先日	平成7年7月11日(1995.7.11)		ラーセ 1	
(33)優先権主張国	スイス(CH)	(74)代理人	100059959	
			弁理士 中村 稔 (外6名)	
前置審査				
		審査官	吉野 公夫	
		(56)参考文献	特開 平3-252606 (JP, A)	
			特開 昭63-250621 (JP, A)	
			特開 平8-292432 (JP, A)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 偏光パターンを移動するための偏光マスク

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 局所的に変化する偏光パターンを光線に付けることにより光構造可能材料に異方性材料特性を生成する方法であって、

入射光からの所定の偏光方向並びに光入力側及び光出力側を有し、光出力側で互いに境界が定められており、かつ異なる偏光方向を有する複数の帯域を含む直線偏光用の偏光マスクを提供すること、及び該マスクを通して光を照射し、局所的に変化する偏光パターンを光線に付け、その光線により光構造可能材料を照射して異方性特 10性を生成するとと、

を特徴とする方法。

【請求項2】 一より多くの偏光方向を有する直線偏光 を偏光 - 感応材料に選択的に露光する方法であって、

(a) 入力側及び出力側を有する偏光マスクであって、

2

該偏光マスクの光出力側で互いに境界が定められ、かつ 異なる偏光方向を有する複数の帯域を有するマスクを提供し、

- (b) 偏光-感応材料を提供し、及び
- (c) 光が偏光マスクの入力側から入り、偏光マスクの出力側から出ていくように偏光マスクを露光して、一より多くの偏光方向を有する直線偏光を偏光 感応材料に選択的に露光すること、

を特徴とする前記方法。

【請求項3】 偏光マスクの偏光方向の少なくとも一部が、光構造可能材料サンプルを露光する前に変えられている請求項1記載の方法。

【請求項4】 偏光マスクの偏光方向の少なくとも一部が、<u>偏光-感応材料</u>サンブルを露光する前に変えられている請求項2記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学部材が偏光 - 感応層の露光において偏光マスクとして使用される、入射光からの所定の偏光方向を有する直線偏光を製造するための光学部材、該部材の製造及びそれらの好ましい使用に関するものである。

3

[0002]

【従来の技術】用語"製造"は、非偏光から直線偏光を 実際に製造すること及び既に直線的に偏光した入射光の 10 偏光方向を変化させることの両方を表すものとして、こ の説明の目的として理解されるべきである。異方性材料 特性が直線偏光を照射することにより誘発される分野に おいて、種々の方法及び材料が近年知られるようになっ た。異方性特性-即ち、ミクロ的に見て小さい帯域での 材料の好ましい方向-は、偏光位置により変化し得る。 光学異方性に加え、これらの材料に工業的興味を与える 立体異方性が、さらに存在する。ポリマー材料と接触し ている液晶は、該材料の立体異方性によりそれらの好ま しい方向で配向する。これらの光構造可能な(photostru 20 cturable) ポリマーはそれ故、液晶の配向層として著し く適しており、配向方向を µm の範囲で変化できる。米 国特許第4,974,941 号明細書は、染料のシスートランス - 異性化による適切な波長の直線偏光を照射することに より好ましい方向が誘発されるゲストーホスト系を基礎 とする方法を記載している。このように照射した表面と 接触している液晶は、好ましい方向で配向している。と の配向方法は可逆的である一即ち、第二の偏光方向の光 で層をさらに照射することにより、既述した配向方向は 再び回転し得る。再配向工程を、必要とされるだけ繰り 返すことができ、それ故、特に再配列可能な光学メモリ ーに関してが興味深い。米国特許第5,389,698 号明細書 は、前述した可逆的配向方法と対照的に、非可逆的異方 性ポリマー網状構造を構成する光構造可能配向層を開示 している。直線偏光で露光中に網状構造で誘発された光 学的及び配向特性は光安定であり、さらに露光してもさ らに再配向出来ない。これらの光-配向ポリマー網状構 造(PPN)はそれ故、安定な、構造化又は非構造化LC配向 層あるいは非-吸収性カラーフィルター、直線又はコレ ステリック偏光フィルター、光学的遅延層等のような光 40 学素子を必要とするところはどこでも使用されている。 【0003】概して、光構造可能配向層の露光におい て、少なくとも2つの異なる光の偏光状態は、一定のパ ターンで書く様、使用されなくてはならない。偏光パタ ーンを光構造可能層に付ける(impress) 種々の露光方法 が現在知られている。公知の方法は全て、全情報が平行 形で伝えられないが、連続的に-即ち、2工程以上の露 光工程で、伝えられなくてはならないという欠点を有し ている。それ故、公知の方法は複雑で、費用がかかり、 かつ時間を消費する。例えば、情報を点状で光構造可能 50

層に施すのにスキャナーを使用できる。この場合、偏光 方向は点毎に変化し得る。しかしながら、高情報内容の バターンの伝達において、バターンに対する全露光時間 が受入れ可能な限界を越えないならば、非常に短い露光 時間のみを各点について利用できる。その結果、配向に 必要なエネルギーを、短時間で層の小領域に施すべきで あり、光構造可能材料の熱負荷は、厳しく抑えられてい る。米国特許第5,389,698 号明細書に記載されている別 の可能性は、層がマスクを通過する偏光で照射されると とである。これにより、同じ配向方向を有する層の帯域 又は領域の全部が同時に露光できるようになる。それ 故、多くの異なる配向方向を、さらにマスクを用いると とにより層に書くことができる。この方法では、各配向 方向、調節されるべき偏光フィルターの伝達方向及び各 時に変更及び配置されるべきマスクに対し露光工程が必 要である。マスクの位置付けは特に時間を消費する操作

【0004】偏光子の特定の透過方向が、この順次露光 工程における各マスクに関連しているので、偏光子自身 がマスクの一部分となり得る。この種の偏光マスクを、 公知技術、例えば、偏光フィルムにフィルムをラミネー トすることで、種々の方法により製造できる。この種の 偏光マスクは、必要な偏光方向全部が、一度の露光工程 で光構造可能層に完全な偏光パターンを移せるよう一つ のマスクに統合することができるならば、改良され得 る。LO配向層を製造するためのこの種の偏光マスクは、 欧州特許第632,311 号公報に記述されているが、そのよ うな偏光マスクを製造する方法については全く示されて いない。実際、偏光フィルムの製造における一般的な方 法を拡張すれば、広領域に渡る不変の偏光方向に自動的 に到る。米国特許第5.327.285 号明細書は、 μm の範囲 で帯域状に異なる2つの偏光方向を有する偏光子を製造 する方法を開示している。この方法は偏光子フィルムを 製造する技術を基礎としている。2つの偏光子フィルム の偏光特性は、化学的又は機械的処理によって帯域状で 消去され、正確に互いに90°離れて一緒に積層されてい る。しかしながら、2つのフィルムを位置付け、それら を接合するという厳しい条件があるので、異なる配向帯 域を必要なだけ小さく作成することは出来ない。又、比 較的厚い偏光フィルムを互いに積み重ねることにより起 こる視差誤差により、可能な偏光方向の数が2に限定さ れる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、例えば、偏光配向バターンを一度の露光工程で偏光 – 感応層に書き込むことを可能にするマスクを製造するのに使用するために、帯域状で異なる偏光方向で、直線偏光が製造されることを可能にする光学部材を考案することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】との目的のために、本発 明により、光出力側で互いに制限されており、かつ少な くとも断続的に異なる偏光方向を有する帯域が存在す

[0007]

【発明の実施の形態】又、本発明の好ましい態様におい て、液晶層は、入射光が、液晶層を通過した後偏光し配 向パターンに従って、光の偏光面が変化するように、異 なる方向で帯域状に配向される。好ましくは、帯域は、 それらの全帯域において、入射直線偏光の偏光面が種々 の角度に回転されるように、光学回転の異なる力を有す る。用語"回転力"は、本明細書中において、ねじれた 液晶が光の偏光方向を回転させる能力及び複屈折により 種々の偏光方向を作りだす能力の両方を示すものとして 理解されるべきである。液晶層の配向は、対応する構造 化配向層により不変的に、もしくは電極を有する液晶セ ルにおいて動的に、決定し得る。後者の場合、配向パタ ーンは、分離している画素点を電気的に活性化すること により非常に簡単に変えられる。これらの偏光マスクの 転換特性により、マスクがコンピュター制御下、何分の 20 一秒かで変換されるのを可能にする、大きな柔軟性が提 供される。それ故、文章、数又はイメージのような情報 の個々の項目は迅速に伝達され得る。他方、偏光パター ンの不変性は、配向層を有する個々の基板上の架橋液晶 層により、又は液晶セルのいずれかにより達成できる が、後者の場合、該セルの2つの配向層の少なくとも一 つが構造化配向を有さなくてはならない。

PPN 材料をNMP に濃度5%まで溶解した。次にこの溶液

を用いて、PPN 層をガラスプレートに2000rpm でスピン コーティングにより施した。次に該層を130℃において ヒートベンチ上で2時間、そして130℃において真空下 でさらに4時間乾燥した。次に、該層を5分間室温下で 200 ワットの極高圧水銀ランプの直線偏光に曝し、その 後該層を液晶の配向層として使用できた。

【実施例2】

架橋LCモノマーから成る層の製造(図1参照)

PPN 層1を実施例1のように製造し、使用した基板2は UV透過性珪硼酸ガラスプレートである。UV光の偏光方向 は、プレートの左及び右半分の放射に対して45。偏って いた。未だ公表されていない特許出願RAN4701/152 に記 載されているように、架橋性LCモノマーの混合物をアニ ソールに20%濃度まで溶解し、露光したPPN 層に室温下 でスピンコートすることにより該混合物を施した。光誘 発架橋のため、該層に真空下で150 ワットキセノンラン プからの等方性光を30分間照射した。架橋した液晶層 (LCP)3 は、機械的、熱的及びLVストレスの点で安定で 50 斜補償板により、プレートの左及び右半分上の液晶はプ

*【0008】不変の偏光パターンを有する偏光マスクに より提供された個光方向は、要求されるように画素毎に 調節できるべきであり、該マスクの使用は、3以上の異 なる配向方向を有するパターンを移すことが必要とされ る場合に特に有用である。この目的に必要な構造化配向 を形成するのに、種々の技術を使用できる。異なる配向 方向の光でマスクを通して露光した光構造可能材料を、 この場合にも使用できるのが好ましい。又、偏光マスク を製造するこのオンーオフ工程を、例えば、異なる方向 で研磨し、研磨されていない帯域を覆うか、機械的な型 10 押しにより配向パターンを付けることによって実施でき るが、これらの工程は、配向層を大量生産するのには手 が込みすぎているだろう。偏光マスクを通して露光する 場合、入射光は、液晶層の前に置かれており、不変の透 過方向を有している従来の偏光子により、又は二色性分 子により液晶をドープすることのいずれかにより偏光で き、光構造可能材料のスペクトル感度により同じものが

説明する。 [0009]

【実施例】

【実施例1】

光構造可能PPN 層の製造

桂皮酸誘導体は、例えば、PPN 材料として考え得る。高 ガラス転移点(Tg=133℃) を有する材料をPPN 層の例と して選択した:

選ばれる。本発明の態様を、添付の図に関して、以後、

【化1】

あった。架橋層を交差偏光子下で観察した時、複屈折で あることが分かった。プレートの左及び右半分の光学軸 4、5は、角度45°を形成した。液晶はPPN層の配向を 引き継ぎ、架橋工程中に配向を保持した。

[0010]

【実施例3】

複屈折マスクによるPPN 層の露光(図2参照)

実施例2で製造した層の光学遅延は、336nm 水銀線付近 で約170nm であった。次に、プレート1、2及び3を、 層側が互いに接触するようにPPN 材料で被覆したガラス ブレート上に複屈折マスクとして設置した。次に、PPN 層を複屈折マスクを通過する波長336nm の偏光UV光6で 5分間照射した。UV光の偏光方向を、複屈折マスクの左 半分の光学軸に対して平行に調節した。それ故、UV光の 偏光方向はマスクの左半分を通過中は維持され、プレー トの右半分はλ/2遅れプレートとして働き、その結 果、偏光方向に90°回転した。露光後、液晶層をPPN層 にスピンコーディングより実施例2のように施した。傾 7

レートの平面上で互いに垂直であることが分かった。90 未満で通過する入射光の偏光面を回転させる複屈折マスクは同様に製造できる。この目的に対し、異なる配向の光学軸間の角度は、45 未満でなくてはいけない。この方法は、光学軸の方向が互いに異なる多くの帯域を有する偏光マスクを製造するのに使用することも出来る。

【0011】 【実施例4】

構造的に配向した、偏光回転マスクとしてのLCセル (図3参照)

実施例2におけるように、PPN 被覆した珪硼酸ガラスプレート7を、直線偏光LW光で照射した。その偏光方向はプレートの左半分及び右半分の照射間に45°回転した。ポリイミド配向層を、第二の珪硼酸ガラスプレート8に施し、長手方向の端に平行に布で研磨した。次に、2つのガラスプレートを結合し、PPN プレートの左半分がポリイミド層と結合して平行セルを形成するように、厚さ6μmのLCを形成した。同様に、PPN の右半分及びポリイミド層の配向方向が角度45°を形成した。次に、セルをネマチック液晶で充填した。偏光子9を、研磨方向に 20平行な透過方向にポリイミドで被覆したガラスプレート*

*の背面に設置した場合、セルの左半分は、偏光子上の分析器の透過方向が偏光子の透過方向と垂直に配置されている時に最大の暗さであった。しかしながら、セルの右半分は、分析器が45°回転したとき最大の暗さであった。結果として、入射光の偏光面は、セルの左半分を通過中変化しないが、右半分では45°回転した。とのセルを、別のPPN被覆ガラスプレート上にPPN側により配置した。次に、PPN層をセルを通してボリイミド研磨方向に平行に偏向したUV光で照射した。次に、液晶層をスピンコーティングにより、PPN層に施した。後者の層を交差偏光子下で観察した時、液晶が配向し、配向方向はプレートの左半分と右半分間で45°異なっていることが分かった。

[0012]

【実施例6】LCP 偏光子

実施例2におけるように、珪硼酸ガラスプレート上のPN 層を、左半分では長手方向の端に平行な偏光で、かつ右半分では、45°の偏光で照射することにより配向した。架橋性LCモノマーの混合物を、以下のシアノターフェニル分子3%でドーブした。

【化2】

最大吸収が、用いたPPN 材料の場合と同じ波長(λ max= 310nm)で起こるため、シアノターフェニルを選択した。 ドープした混合物をアニソール中に40%濃度まで溶解 し、スピンコーティングにより室温下で露光したPPN 層 に施した。液晶は、PPN 露光により決定した配向を引き 継ぎ、続いて起こる架橋後に、その様な配向を保持し た。シアノターフェニル類は、それ自身、液晶マトリッ クスに従って配向し、このことは、指導子(director)に 平行な310nm で測定した透過率が、指導子に垂直な透過 率と比較して20倍小さいという事実から明らかとなっ た。使用した架橋性液晶分子は300nm 以上の範囲での吸 収に寄与しないため、これはシアノターフェニル類の二 色性によるべきである。得られたプレートを、その層側 面がPPN 被覆ガラスプレート上で下に向かうようにし て、偏光マスクとして設置し、マスク側の面から等方性 LW光を照射した。次に、液晶層をPPN 層にスピンコーテ※40

※ ィングにより施した。スピンコートした層を交差偏光子の下に設置すると、液晶が配向し、プレートの左半分と右半分の配向方向が互いに45 異なっていることが分かった。LCP 偏光マスクを感光性材料の配向バターンを生成させるのに使用することにより、外部の偏光子を使用する必要がない。偏光及び偏光面の決定を偏光マスクにより画素毎に処理される。

[0013]

【実施例6】

LCP 偏光子

実施例2 におけるように、珪硼酸ガラスプレート上のPN 層を、左半分では長手方向の端に平行な偏光で、かつ右半分では、45°の偏光で照射することにより配向した。架橋性LCモノマーの混合物を、以下のシアノターフェニル分子3%でドープした。

【化2】

50

最大吸収が、用いたPPN 材料の場合と同じ波長(λ max=310nm)で起こるため、シアノターフェニルを選択した。 ドープした混合物をアニソール中に40%濃度まで溶解 し、スピンコーティングにより室温下で露光したPPN 層 に施した。液晶は、PPN 露光により決定した配向に引き 継ぎ、続いて起こる架橋後に、その様な配向を保持し た。シアノターフェニル類は、それ自身、液晶マトリッ クスに従って配向し、このことは、指導子(director)に 平行な310nm で測定した透過率が、指導子に垂直な透過 率と比較して20倍小さいという事実から明らかとなっ た。使用した架橋性液晶分子は300nm 以上の範囲での吸 収に寄与しないため、これはシアノターフェニル類の二 色性によるべきである。得られたブレートを、その層側 面がPPN 被覆ガラスプレート上で下に向かうようにし

10

て、偏光マスクとして設置し、マスク側面から等方性IV 光を照射した。次に、液晶層をPPN層にスピンコーティ ングにより施した。スピンコートした層を交差偏光子の 下に設置すると、液晶が配向し、プレートの左半分と右 半分の配向方向が互いに45 異なっていることが分かっ た。LCP 偏光マスクを感光性材料の配向パターンを生成 させるのに使用することにより、外部の偏光子を使用す る必要がない。偏光及び偏光面の決定を偏光マスクによ り画素毎に処理される。

構造的に配向した、偏光マスクとしての液晶セル

[0014]

【実施例7】

実施例2におけるように、珪硼酸ガラスプレート上のPP N 層を、左半分において長手方向の端に平行となるよう に、かつ右半分において長手方向の端に対して45°とな るように偏光を照射することにより配向した。ポリイミ ド配向層を第二の珪硼酸ガラスプレート上に施し、長手 方向の端に平行に布で研磨した。次に、2 つのガラスプ レートを、PPN プレートの左半分がポリイミドプレート と結合して、平行セルを形成するように厚さ6 μm のLC 20 セルを形成した。同様に、PPN の右半分の配向方向及び ポリイミド層の配向方向が互いに角度45 を形成した。 次に、セルを1%シアノターフェニルでドープした液晶 混合物で充填した。透過方向が研磨方向に平行であるよ うポリイミド被覆ガラスプレートの背面に偏光子が設置 されている場合、セルの左半分は、偏光子上の分析器の 透過方向が偏光子の透過方向に垂直である時に最も暗い 状態であった。しかしながら、セルの右半分は、分析器 が45 回転した時に最も暗い状態であった。入射光の偏 光面は、セルの左半分を通過中は変化せず、右半分を通 過中は45 回転した。このセルを、別のPPN 被覆ガラス プレート上に、PPN 側を介して設置した。次に、PPN 層 をセルを通過する等方性UV光で照射し、その後、液晶を

スピンコーティングにより PPN 層に施した。次にこの層

が交差偏光子の下に設置した時、プレートの左半分と右

半分における配向方向は、互いに45°異なっていた。と

の実施例により、構造的に配向したLCD 偏光マスクによ

る露光は、追加的な外部偏光子を必要としないことが分米

*かる。

[0015]

【実施例8】

自己-偏光転換可能LCD マスク

ITO の指電極を、珪硼酸ガラスプレート上に 1 cm² の領 域で製造した。プレートの端に平行に配置されている電 極路の幅は20µmであり、路間の距離は40µmであっ た。次に、ポリイミド層を上部に施し、電極路方向に対 し45°で布を用いて研磨した。電極のない第二の珪硼酸 10 プレートをポリイミドで被覆し、2つのプレートを組合 わせた後に平行セルが生ずるように、長手方向の端に対 して45°で研磨した。プレート間の距離は6μmであっ た。 負の誘電異方性を有するネマチック液晶混合物を 1 %シアノターフェニルでドープし、セル中に装填した。 適当な高電圧を該指に印加した時、電極プレート付近の 電極分子は電極路に平行に配向した。その結果、液晶は 指電極付近で45 ねじれを有する構造を有し、一方、平 行の確認は電極外部の転換していない帯域におけるまま であった。次に、セルをPPN 被覆ガラスプレート上に設 置した。次に、PPN 層に転換セルを通して等方性UV光を 照射し、その後、液晶層をPPN 層にスピンコーティング により施した。次に液晶層が交差偏光子の下に設置する と、液晶が配向し、指電極領域で覆われている帯域にお ける配向方向は、外部の帯域における配向方向と45 異 なっていることが分かった。この構造においても外部の 偏光子を必要としなかった。ドープした液晶混合物でUV 光を偏光した。偏光面は、セルの活性化により45 転換 可能である。それ故、情報の異なる項目を変換する間に マスクを変化させる必要はない。

【図面の簡単な説明】

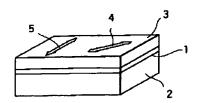
【図1】帯域状で種々の配向を有する架橋したLCモノマーの層を製造するための配置を示す。

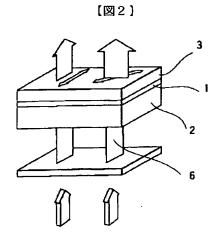
【図2】図1に従って製造した層を複屈折マスクとして 使用する場合の配置を示す。

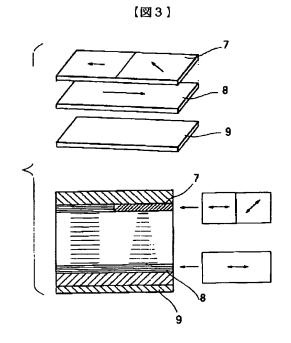
【図3】構造的に配向したLCセルを偏光-回転マスクとして使用する場合の配置を示す。

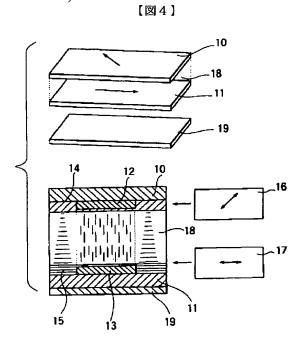
【図4】電気的に転換可能な偏光-回転マスクを示す。

【図1】









フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

G02F 1/13 500

G02B 5/30 G02F 1/1335